

Nano Dip®镀膜仪 ND-0407-S5

日本原装实验室/研发专用台式浸渍提拉镀膜仪，z轴和x轴双轴控制，具有提拉角度调节功能。

ND-0407-S5 日本最佳的超低速浸渍提拉镀膜仪，它可以通过控制工作两轴和 θ 角以及对角线提拉来调节提拉角度。

客户的需求：

- ✚ 对基材进行垂直、高精度、超低速镀膜
- ✚ 以改变提拉角度和溶液的密度对基材进行镀膜
- ✚ 两种液体交替对基材进行镀膜
- ✚ 在提拉途中，通过改变提拉速度来控制膜厚

ND-0407-S5 能够满足客户的需求：

- ✚ 可以提供超低速的常规垂直镀膜
- ✚ 可以通过调整 θ 角来获取提拉角度
- ✚ 可以采用不同的液体（例如交替吸附等）进行镀膜
- ✚ 双轴可独立运动和复合运动操作
- ✚ 具有可以连续点运行的新功能



产品特点：

- 可以对玻璃、有机玻璃、铜箔、管状材料等基材以纳米速度（变速单位：1nm）进行浸渍镀膜。
- 适用于纳米级薄膜、蛋白石薄膜的形成和粒子阵列的生成等。
- 采用触控面板操作方式，在触控面板上，可以轻松完成设置速度变化点(最多 16 个点)、速度变化(以 1nm 为单位)、重复运动、运动模式记忆(最多 8 个模式)的操作。
- 双轴同步操作和单轴单独运行操作都可以轻松完成。
- 触控面板采用日语、英语两种语言，且可以一键式切换。

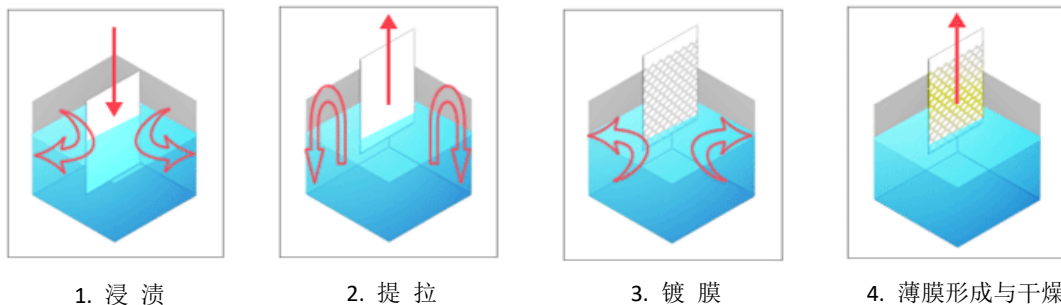
产品应用：

- 主要用于溶胶-凝胶法等液相法制备薄膜材料。

工作原理:

浸渍提拉镀膜仪的原理是将基材垂直浸入镀膜溶液(溶胶)中浸渍,然后将基材从溶液中垂直低速提拉起来,并使附着的液膜在空气(气相)中凝胶的方法。

浸渍提拉法的具体工艺流程如下:



1. 将基材垂直浸入镀膜溶液(溶胶)中浸渍。
2. 利用镀膜溶液的粘度、表面张力和重力之间的相互作用开始提拉,提拉过程必须保证液面无振动,且基材垂直、匀速、平稳、连续上升,从而确保在基材表面形成连续、均匀的薄膜。
3. 基材的提拉速度与镀膜溶液的粘度和附着液向下流动的重力之间的关系,控制着镀膜的厚度;
4. 形成均匀的薄膜,并完成“湿凝胶膜”向“干凝胶膜”的转变。“干凝胶膜”经过进一步的干燥及高温热处理便得到所需的纳米薄膜材料。

主要技术参数			
行程	Z轴: 100mm; X轴: 100mm	存储程序的数量	8个程序
最小速度(Min)	1nm/s	监控功能: 当前速度	有
最大速度(Max)	60mm/s	监控功能: 当前位置	有
操作方法	触控面板	剩余监控时间	有
屏幕显示语言	英语/日语	重复运行	有
处理速度指定数量	16个	标准夹具	材料: 聚丙烯(PP)
停止位置指定数量	16个	电源	AC100V、300VA
停止时间指定数量	16个	最大承重量	500g
连续运行模式	有	最大处理尺寸(mm)	H: 100mm
手动运行模式	有	线性运行模式	无
设备尺寸(mm)	442(W)×250(D)×451(H)	控制箱尺寸(mm)	300(W)×285(D)×163(H)

※ 线性运行模式是指改变速度时,停止时间为零秒。

※ 手动运行模式是指以设定的速度进行上升/下降运行(上升速度和下降速度的另一种设置)。

Micro Dip®镀膜仪 MD-0408-S7

日本原装实验室专用高端台式浸渍提拉镀膜仪

日本最热销的超低速浸渍镀膜（浸涂）的浸渍提拉镀膜仪。速度可变范围 **1nm/sec** 到 **60mm/sec**。



产品特点：

- 可以对玻璃、有机玻璃、铜箔等基材以纳米级速度(变速单位：**1nm**)进行浸渍镀膜。
- **1nm/s** 的超慢速浸渍镀膜有利于分离膜的生成、粒子阵列重排、纳米级膜厚的形成。
- 采用触控面板操作，可控 16 级变速程序、可控变速范围（变速单位：**1nm/sec**）、往复运转、存储 8 个运转模式。
- 日语、英语显示可以一键式切换。

产品应用：

- 主要用于溶胶-凝胶法等液相法制备薄膜材料。

主要技术参数			
行程	150mm(最大 800mm)	运转模式存储数量	8 个运转模式
最小速度(Min)	1nm/s	电机功能：当前速度	有
最大速度(Max)	60mm/s	电机功能：当前位置	有
操作方法	触控面板	电机功能：运行剩余时间	有
画面文字	英语/日语	重复运行	有
处理速度指定级数	16 级	标准夹具	聚丙烯 (PP) 材质
停止位置指定个数	16 个	电源	AC100V、250VA
停止时间指定数量	16 个	最大搬运重量	1kg
连续运行模式	有	最大处理尺寸 (mm)	H:150mm
手动运行模式	有	直线运行模式	无

※连续运行模式是指：改变速度时，停止时间为“0sec”。

※手动运行模式是指：以设定的一个速度上升/下降运行（上升速度和下降速度分开设定）

Swing Dip®镀膜仪 SD-0808-M2

SD-0808-M2 是一款能够将基材倾斜进行镀膜的浸渍提拉镀膜仪，具有提拉角度调节功能。它的速度变化范围从 40nm/s 到 40mm/s，使用简单方便。

产品特点：

- 适用于对具有倾斜角度的硅晶片、玻璃、陶瓷等进行对角浸渍镀膜
- 通过触控面板可以完成所有的操作
- 设备操作和维护简单



产品应用：

主要用于溶胶-凝胶法等液相法制备薄膜材料。

主要技术参数			
行程	150mm	存储程序的数量	8 个程序
最小速度(Min)	40nm/s	监控功能：当前速度	有
最大速度(Max)	40mm/s	监控功能：当前位置	有
操作方法	触控面板	剩余监控时间	有
屏幕显示语言	英语/日语	重复运行	有
处理速度指定数量	16 个	标准夹具	材料：不锈钢
停止位置指定数量	16 个	电源	AC100V、250VA
停止时间指定数量	16 个	最大承重量	1kg
连续运行模式	有	最大处理尺寸 (mm)	H: 150mm
手动运行模式	有	线性运行模式	无
设备尺寸(mm)	510(W)×510(D)×700(H)	控制箱尺寸(mm)	300(W)×285(D)×163(H)

※线性运行模式是指改变速度时，停止时间为零秒。

※手动运行模式是指以设定的速度进行上升/下降运行（上升速度和下降速度的另一种设置）。